

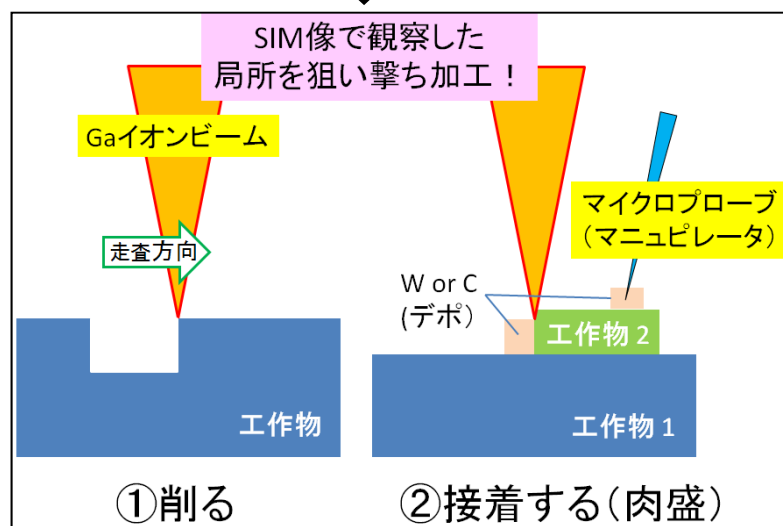
# 局所位置からのTEM用試料作製(FIBマイクロサンプリング)

利用事例：接合界面の断面組織TEM観察試料作製(FIB-TEM法)

## 問題

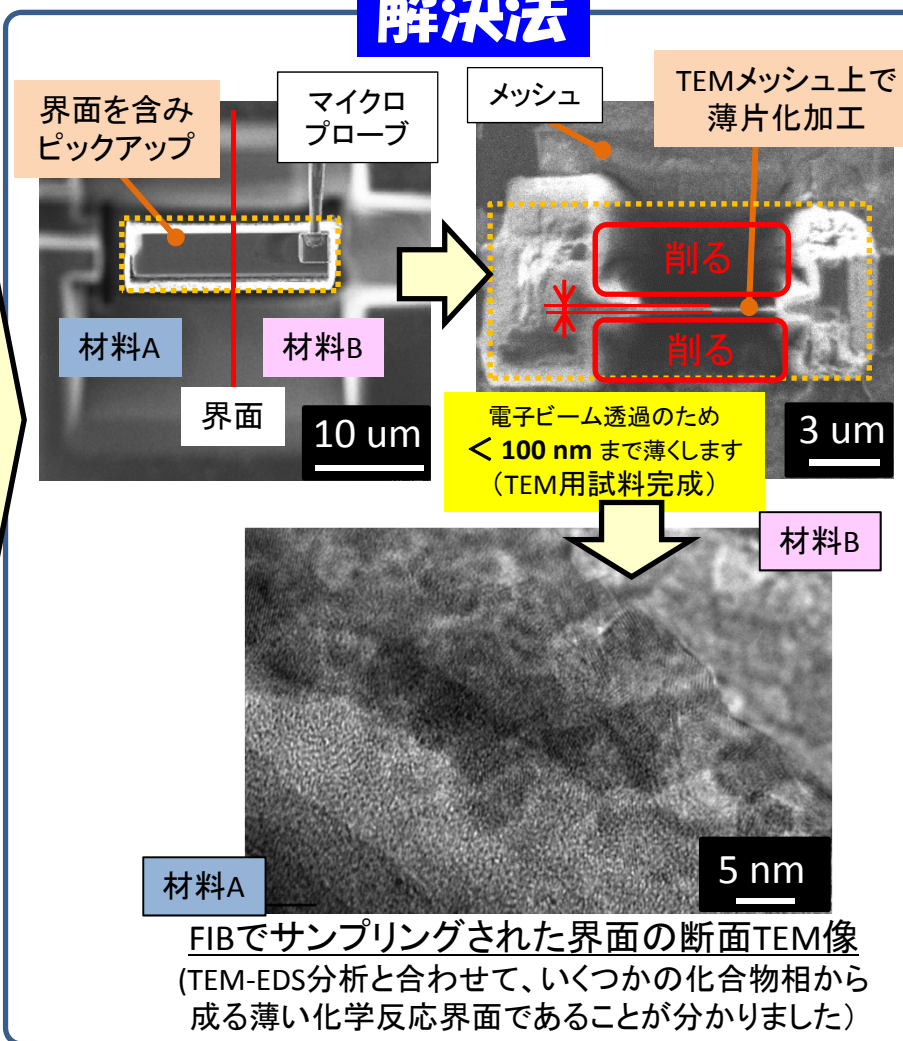
接合界面をナノスケールで観察・分析したいけど。。。  
(SEM-EDS法では分解能不足。TEMで観察したいが  
電界研磨法では界面を狙った薄片化は不可能)

局所位置 ↓ そんなときにFIB!



FIBの基本能力

## 解決法



使用装置： 集束イオンビーム加工機 (株)日立ハイテクフィールドディング: FB2200)